



剖面圖 A-A

註:
1.數量:1件
2.表面磷酸鹽皮膜處理

F					加工一般公差	孔與孔中心距公差 ±0.3 鑽孔、沉頭孔公差 +0.25 -0.05 角度±1° 	繪圖	潘韋龍		2026/4/17			工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute		
					>0 ±0.1		設計			2026/4/17			名稱	TCP治具	
					>6 ±0.2		審校								
					>30 ±0.3		核准								
					>120 ±0.5		比例	1:1	材質	SS400	圖號	MSLQ500G04			
					>400 ±0.8										
版次	座 標	更 改 內 容			修改者	日 期									